

無線通信用 GaN HEMT の 歪み特性 改善

GaN HEMT Linearity Improvement for Wireless Communication Applications

井上 和孝^{*} Kazutaka Inoue

山田 文生 Fumio Yamada 山本 Hiroshi Yamamoto 山本 高史

Takashi Yamamoto

中田 健 Ken Nakata

佐野 征吾 Seigo Sano

GaN HEMTの歪み特性の改善は、ポイント to ポイントシステムといったマイクロ波帯通信用デバイス市場への浸透を深める上で重要な技術課題である。この論文は、無線通信用 GaN HEMTの歪み特性改善に向け、非線形要素を取り込んだ大信号モデルを構築し、このモデルを活用した GaN HEMTの歪み特性改善の検討をまとめたものである。構築した大信号モデルを用いた解析により、10 dB 以上のバックオフ領域の歪み特性はドレイン電流立ち上がり領域の相互コンダクタンス(gm)プロファイルが大きく影響することを解明した。これを踏まえて薄い n 型層を挿入したバッファ層(ini層)を有する GaN HEMT を試作し、8 dB 以上ものバックオフ領域の歪み特性を実現した。

For GaN HEMTs to be widely used for microwave amplifiers such as point-to-point backhaul systems, good linearity is required. This paper describes our recent achievement in improving linearity by using a newly constructed large signal model of a 0.4 μ m GaN HEMT. The model analysis revealed that the intermodulation distortion (IMD) at a backed-off region of more than 10 dB is determined by the sub-threshold gm profile; in other words, steep rising gm profile degrades IMD. We created a GaN HEMT that has a thin *n* layer inserted in the buffer (ini-buffer) structure, and achieved a significant IMD improvement in the backed-off region of more than 8 dB.

キーワード: GaN HEMT、歪み特性、gm、大信号モデル、マイクロ波

1. 緒 言

シリコン(Si)や砒化ガリウム(GaAs)と比較してバ ンドギャップと飽和電子速度が大きい窒化ガリウム(GaN) を用いて、高出力かつ高速の電子デバイスの開発と実用化 が進められている^{(1)~(3)}。当社は、放熱性に優れた炭化ケイ 素(SiC)基板を用いた、窒化ガリウム高電子移動度トラン ジスタ(GaN HEMT*1:Gallium Nitride High Electron Mobility Transistor)を、世界に先駆けて製品化した。 GaNデバイスの高出力・高効率・広帯域性の認知ととも に、携帯電話基地局用途等での採用が広がっている。



図1 通信インフラ網の概観

図1は現在の主な通信インフラ網を抽出したものである。 携帯電話基地局以外のマイクロ波帯無線通信インフラとし ては、基地局間無線通信や幹線系の無線通信、衛星通信等 が存在する。これらの通信は6~16 GHz帯の周波数を使用 する。すなわち2 GHz前後の周波数を用いる携帯電話基地 局より、高い周波数で動作可能なデバイスが要求される。 GaN HEMTの高周波動作化が実現できれば、より広範な無 線通信インフラへの活用可能性が広がることになり、各社 精力的な技術及び製品開発を進めている。

通信のディジタル化、高ビットレート化に伴い、通信シ ステムには、高い線形性が求められる。携帯電話基地局で は、Digital-Pre-Distorter (DPD)と呼ばれる歪み補償回 路で良好な線形増幅を実現することが一般的である。

他方、基地局帯以外のマイクロ波無線通信では、周波数 が高いために歪み補償回路の構成が困難になること、シス テムの簡便さの要求から複雑な回路構成が採用できない等 の制約が増すことから、素子自体の良好な歪み特性が求め られる。本報告は、GaN HEMTの歪み特性改善に向けた 我々の取り組みを紹介するものである。

2. GaN HEMT と歪み特性

GaNは3.4 eVもの大きなバンドギャップを有することか ら耐圧特性に優れ、高電圧動作が可能である。また飽和電 子速度は2.7×10⁷ cm/sとGaAsよりも2倍以上高い。更には、 窒化物半導体は自発分極とピエゾ分極により、ヘテロ接合 界面に1×10¹³ cm⁻³もの高密度の二次元電子ガス(2DEG)を 生成できるといったユニークな特徴を有する。

次いで歪み特性の評価指標について説明する。異なる周 波数の2波(f_1 , f_2)を増幅する場合を考える。理想的な (完全に線形な)増幅器では、周波数 f_1 , f_2 の増幅信号が出力さ れる(**図2**(**a**))。しかし、現実の増幅器は非線形であり、 入力波以外の周波数の信号が出力に現れる。これを相互変 調歪み(Intermodulation Distortion: IMD)と呼び、基本 波 f_1 , f_2 に対する3次の相互変調歪みは、周波数2 f_1 - f_2 と 2 f_2 - f_1 で現れる(**図2**(**b**))。



本検討において標準とした GaN HEMT構造を図3 (a) に 示す。4インチの半絶縁性 SiC 基板上に有機金属気相成長法 (Metal Organic Chemical Vapor Deposition: MOCVD) により AlGaN/GaN 積層構造をエピタキシャル成長した。 高周波動作を意図して、0.4 μ mの微細ゲート構造を採用、 AlGaNバリア層は設計ゲート長に対して良好なピンチオフ 特性と所望の飽和電流 (Irmax) 特性が得られるよう、組成 と厚みを設定している。

マイクロ波無線通信のアプリケーションの1つである、 Point-to-Point (P-to-P)システム用には、線形動作領域 で-40 dBc以下のIM3レベルが要求される。標準的なGaN HEMTではバックオフ領域で棚形状を有するIM3プロファ



図3 (a)標準GaN HEMT (b) IMD 特性

イルとなり、バックオフ歪み悪化の主因となっている。 GaAsは10 V程度の動作電圧で歪み特性上有利なA級動作 を採用できる。他方、GaNはその材料優位性を発揮させる ため、24 V程度の動作電圧を採用するが、効率特性確保の観 点から、ドレイン電流を絞ったAB級動作が必須となる。 GaNのIMD特性がGaAsに対して劣るのは、AB級動作に 伴うIM3プロファイルにおいて棚形状が生成することによ るところが大きい。今後GaNで大出力・高効率なP-to-P 向けデバイスを実現するには、このAB級でのIM3プロ ファイルの棚の改善は重要な課題と言える。そこでまず 我々は、GaN HEMTのデバイスモデルを構築して、動作を 解析することにした。

3. デバイスモデル構築とモデルによる解析

マイクロ波トランジスタの大信号解析には、各種のモデ ルが提案されている。今回、我々はAngelovモデル^{(4)、(5)} を用いてモデル化を行うことにした。Angelovモデルは、 等価回路パラメータを用いた直観的な記述が可能な点で特 徴的であり、解析に要する演算時間も比較的短時間である ため、今回の解析には有効と判断した。



図4 小信号等価回路モデル

モデルの構築のため、まずは各種バイアス条件下でSパ ラメータ測定を行い、この測定値をもとに各バイアス点で の等価回路パラメータを導出した。導出した等価回路の一 例として、相互コンダクタンスgmのゲート電圧(Vg)及び ドレイン電圧(Vd)依存性を図5に示す。測定モニタはユ ニットフィンガー幅(Wgu)が50 µmの6本ゲートになる。 今回構築した大信号モデルでは、上述のgmに加えてゲー ト・ソース間容量Cgs、ゲート・ドレイン間容量Cgd及び

ソース・ドレイン間抵抗Rdsを非線形要素として扱うこと として、同様の導出を行った。

DC特性のモデル化は、相互コンダクタンスとドレイン



図5 gm特性のゲート電圧・ドレイン電圧依存性

コンダクタンスの非線形性を考慮して行うことにした。 GaN HEMTでは、高ドレイン電圧印加による半導体表面近 傍への電荷の捕獲・放出による過渡的な電流低下、いわゆ る電流コラプス現象を考慮する必要がある。図6(a)は静 バイアスゼロ(電圧ストレスなし)でパルス的に測定した IV波形、図6(b)は、静バイアスを与えて(電圧ストレス ありで)、測定したIV波形を示したものである。



図6 (a) 電圧ストレスなし波形 (b) 電圧ストレスあり波形

GaN HEMTを高精度にモデル化するには、実動電圧ストレ ス下でのDC特性を適切に取り込むことが重要である。今回 は実動時の想定動作電圧を勘案して、24 Vストレスでのµ秒 パルス測定によりコラプス電流波形を取得、以下に示す Angelovの表式 (5) にフィッティングさせた。

$$I_{ds} = IPK0 \times (1 + \tanh(\Psi)) \times \tanh(\alpha \times V_{ds})$$

$$\times (1 + LAMBDA \times V_{ds} + LSB0 \times \exp(V_{dg} - VTR))$$
 (1)

(1) 式において、IPK0, Ψ , α , LAMBDA, LSB0及び VTRがフィッティングパラメータとなる。

次いで、構築したモデルを用いた解析について述べる。モ デルの妥当性・定量性を吟味するため、実測データとの対比 を行った。得られたパラメータをもとに、ドレイン電圧24 V、最大飽和ドレイン電流の10%電流設定、動作周波数10



GHzでの特性を解析した。図7(a)は入出力特性、図7(b) は三次相互変調歪み(IM3)の解析値と実測値を示している。 実線で示した解析値と、プロットで示した実測値とは良 く一致しており、作成したモデルは妥当なものと判断した。 そこで、このモデルを用いて、GaN HEMTの歪み特性の 解析と改善検討を行った。一般に歪みの起源は、振幅起因 と位相起因とに大別される。中でも振幅歪みに大きく影響 を与えるgm特性に注目して解析を行った。図8にはいく つかのRF入力信号レベルに対するgmの時間軸プロットを 示す。

入力レベルが小さいとき (-10 dBm) には、gm は比較的き



図8 gmの時間軸表示



図9 入力信号レベルに対するgm解析値

れいな振動波形を示すが、まず最大側がクリップされ (Pin = 0 dBmの波形)、次いで最小側もクリップされる (Pin = 10 dBmの波形)。図9には、gmの最大値、最小値、及び平均 値を各入力レベルに対してプロットした。

図8と図9の対比から興味深い事実が読み取れる。図8の gm波形の最大値側・最小値側(ゼロ点)でのクリップ波形 は、歪み特性の観点で注目すべき波形であるが、対応する パワーレベルは、前者は図9の平均値の変曲点から-5 dBm 入力点近傍、後者は図9の最小値が軸と交わる点から+2 dBm入力点近傍と見積もることができる。

図10は、gmプロファイルを示す。実線が本モデルで算 出したロードライン上のgmプロファイルであり、●印が静 バイアス点となる。RF動作では、この点を中心として入力 信号レベルに応じて振動している。



図10 gm プロファイル(実測と仮想値)

当初、我々は入力信号レベルに対して、gmが複雑な曲率 で変化(低下)していくことが、GaN HEMTの歪み特性が 悪い一因と想定した。そこで今回構築したモデルを用いて 図10点線のような仮想の矩形gmプロファイルを設定して、 歪み特性を解析した(図11)。



当初の想定に反して、15 dBバックオフ近傍のIM3が悪 化し棚状のプロファイルとなった。更に解析を進めると、 この棚状部は図10の仮想波形でのgmのOFFからONへの 急峻な変化領域に対応することが分かった。

以上の解析は、急峻なgn立ち上がりはむしろ歪みを悪化 させ、なだらかに立ち上がるプロファイルの方が、バック オフした信号レベルでのIM3特性改善を示唆するものと なった。この解析結果に基づき、次章に示す新規のGaN HEMT構造を設計・試作し、評価を行った。

4. GaN HEMT 試作と評価結果

既に述べたように、GaN HEMT は強い分極作用を有する ため、gm は急峻に立ち上がるのが自然な挙動である。この ような系で、なだらかに立ち上がるgm プロファイルを実現 するため、図12に示すようなi-GaN層中に薄いn型ドープ 層を有する構造を発案し、試作を行った。

エピ構造はAlGaN層上にバッファ層及び電子走行層と なるGaN層を形成、更にAlGaNバリア層とGaNキャップ 層を有する点で従来構造と同じであるが、本試作構造での GaNバッファ層は上側から数十nm深さに高濃度でパルス 的にSiドープを行うことを特徴とする。電子走行層である 高濃度n-GaN層を、意図的にドープをしないi-GaN層で挟 んだ構造になることから、我々はこの構造を"iniバッファ 構造"と名付けた。



図12 新GaN HEMT 構造とバンドダイアグラム

この薄いnドープ領域は、図12に示すようなGaN層の バンドプロファイル変調を意図したものである。図13は試 作したini構造と通常構造のgmプロファイルを比較したも のである。ini構造において、立ち上がり領域のgmプロ ファイルが有意になだらかになっていることが分かる。よ り定量的な比較として、3次のドレイン電流微分項(gm3) をゲート電圧に対してプロットした結果を図14に示すが、 n-GaN薄層の挿入は、顕著なgm波形の変動をもたらすこ とが分かる。



図13 iniバッファ構造のgmプロファイル



図14 iniバッファのドレイン電流3次微分項(gm3)



図15 iniバッファ構造のIM3 プロファイル

次にiniバッファ構造の歪み特性(IM3)プロファイルを 図15に示す。ドレイン電圧24 V、最大飽和ドレイン電流の 10%電流条件に設定し、8 GHzで測定を行っている。

iniバッファ構造の適用により、電流立ち上がり領域でのなだらかなgmプロファイルとともに、12 dBバックオフ点で8 dBもの有意な歪み特性の改善が得られた。

6. 結 言

普及・発展が進む高速無線通信P-to-Pシステム等に、出 力特性・効率特性に優れるGaN HEMTを適用すべく、歪み 特性の改善を検討した。大信号モデルを活用した解析を通 して、しきい値近傍でのgmの非線形性が歪み特性に大きく 影響することを解明した。この非線形性を改善すべく、新 たにパルスドープした電子走行層を有するGaN HEMT構造 (iniバッファ構造)の考案と試作を行い、12 dBバックオフ 点での8 dBの歪み特性改善を確認した。今後ともP-to-Pシ ステムを始めとする高周波・高出力デバイスへの要求に応 えるべく、GaN HEMTの技術開発・製品開発を進めていく。

用語集—

※1 GaAs FET

Gallium Arsenide Field Effect Transistor:素材にガリ ウム砒素を用いている高周波増幅に適した、電界効果型ト ランジスタ。シリコンに比べ、電子が5 倍近いスピードで移 動できることから、マイクロ波増幅用等に適している。

※2 HEMT

High Electron Mobility Transistor:高電子移動度トラン ジスタ。半導体ヘテロ接合界面に二次元電子層を形成した ことを特徴とする。低雑音、高利得の特性を持っている。

※3 Sパラメータ

高周波電子回路や電子部品の特性を表すために用いられる 回路網パラメータの一種で、回路網の透過・反射電力の強 度と位相により表現される。

- (1) T. Kikkawa, T. Maniwa, H. Hayashi, M. Kanamura, S. Yokokawa, M. Nishi, N. Adachi, M. Yokoyama, Y. Tateno, and K. Joshin, "An over 200-W output power GaN HEMT push pull amplifier with high reliability," 2004 IEEE MTT-S IMS Digest, pp. 1347-1350 (2004)
- (2) H. Deguchi, N. Watanabe, A. Kawano, N. Yoshimura, N. Ui, K. Ebihara, "A 2.6GHz Band 537W Peak Power GaN HEMT Asymmetric Doherty Amplifier with 48% Drain Efficiency at 7dB", 2012 IEEE-MTTs-IMS Digest, pp. 139 (2012)
- (3) N. Ui , H. Sano and S. Sano, "A 80W 2-stage GaN HEMT Doherty Amplifier with -50dBc ACLR, 42% Efficiency 32dB Gain with DPD for W-CDMA Base Station", 2007 IEEE MTT-S IMS Digest, pp. 1259-1262 (2007)
- (4) I. Angelov, H. Zirath, and N. Rorsman, "A new empirical nonlinear model for HEMT and MESFET devices," IEEE Tran. Microwave Theory Tech., vol. 40, pp. 2258-2266 (December 1992)
- (5) I. Angelov, L. Bengtsson, and M. Garcia, "Extension of the Chalmers nonlinear HEMT and MESFET model," IEEE Tran. Microwave Theory Tech., vol. 44, pp. 1664-1674 (October 1996)
- (6) D. E. Root, "Nonlinear charge modeling for FET large-signal simulation and its importance for IP3 and ACPR in communication circuits," Proc. 44th IEEE Midwest Circuits Syst. Symp., vol. 2, pp. 768-772 (August 2001)

- (7) R. A. Minasian, "Intermodulation Distortion Analysis of MESFET Amplifiers Using the Volterra Series Representation," IEEE Tran. Microwave Theory Tech., vol. 28, pp. 1-8 (January 1980)
- (8) W. Nagy, J. Brown, R. Borges, and S. Singhal, "Linearity Characteristics of Microwave Power GaN HEMTs," IEEE Tran. Microwave Theory Tech., vol. 51, pp. 660-664 (February 2003)
- (9) E. R. Srindhi, A. Jarndal, and G. Kompa, "A New Method for Identification and Minimization of Distortion Sources in GaN HEMT Devices Based on Volterra Series Analysis," IEEE Electron Device Lett., vol. 28, pp. 343-345 (May 2007)

| 執 筆 者 | | | |
|-------|-----|--------------------------------------|--|
| 井上 | 和孝* | : 伝送デバイス研究所 グループ長 | |
| 山本 | 洋 | :住友電工デバイス・イノベーション(株) 電子デバイス事業部 | S |
| 中田 | 健 | : 伝送デバイス研究所 グループ長 | |
| 山田 | 文生 | :住友電エデバイス・イノベーション(株) 電子デバイス事業部 | |
| 山本 | 高史 | :住友電エデバイス・イノベーション㈱ 電子デバイス事業部 担当部長 | and the second s |
| 佐野 | 征吾 | :住友電氣(亞洲)有限公司 | |

* 主執筆者